



Einladung

Wir laden ein zu einem Vortrag über das Thema:

"Elektronenstrahl-Lithographie: Geschichte und aktuelle Technologie- und Anwendungstendenzen"

Es spricht Herr Matthias Slodowski (Vistec Electron Beam GmbH in Jena)

Die Veranstaltung findet statt am

Dienstag, 16. September 2025, 18.00 Uhr im Universitätshauptgebäude, Hörsaal 250.

Nichtmitglieder bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 3 Euro.

Inhalt des Vortrags:

Im Vortrag werden auf der Basis eines historischen Abrisses aktuelle Tendenzen der Elektronenstrahl-Lithographie allgemeinverständlich dargestellt.

Beginnend mit einer Rückblende bis zur Elektronenmikroskopie, aus der sich das Schreiben mit Elektronenstrahlen in den 1960er Jahren entwickelt hat, werden verschiedene Technologien und deren Anwendungen geschildert, wobei insbesondere die vielfältigen Beiträge aus Jena gewürdigt werden.

Die Vorstellung ganz aktueller Technologien wie das Schreiben mit hunderttausenden Elektronenpixeln und Anwendungen in Mikro-Elektronik und Nano-Optik runden den Vortrag ab.

Wissenschaftliche Biografie des Vortragenden:

Matthias Slodowski ist Geschäftsführer der Vistec Electron Beam GmbH in Jena.

Nach dem Studium der Kernphysik in Dresden und dem Eintritt bei Zeiss 1988 arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Entwicklung von Prozess- und Messgeräten für die Mikroelektronik.

Seit 2004 verantwortete er den Entwicklungsbereich der Elektronenstrahl-Lithographie von Leica Microsystems in Jena, aus der 2005 die Vistec Electron Beam GmbH hervorging. 2018 übernahm er deren Geschäftsführung.

i.A. Karl-Heinz Donnerhacke

Karl-Heinz Donnerhacke